05.06

# Магнитоэлектрический эффект в тонкопленочных магнитострикционно-пьезоэлектрических структурах, выращенных на подложке

© Д.А. Филиппов

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого,

Великий Новгород, Россия

E-mail: Dmitry.Filippov@novsu.ru

(Поступила в Редакцию 15 ноября 2011 г.)

Представлена теория магнитоэлектрического эффекта в структуре тонкая магнитоэлектрическая пленка—пассивная подложка. На основе совместного решения материальных уравнений и уравнений движения пленки и подложки получено дисперсионное соотношение для упругих волн, распространяющихся в плоскости образца. Показано, что в том случае, если скорость распространения упругих колебаний в подложке больше, чем в магнитоэлектрической пленке, распространение упругих колебаний в подложке происходит в приповерхностном слое. При этом толщина подложки практически не оказывает влияния на величину эффекта.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 11-02-98801-р\_север\_а и программы "Развитие научного потенциала высшей школы" (проект № 2.1.1/10009).

### 1. Введение

В последнее время активно исследуется магнитоэлектрический (Н) эффект в тонкопленочных магнитострикционно-пьезоэлектрических структурах, выращенных на подложке [1,2]. Такие структуры имеют специфические особенности по сравнению с объемными и многослойными композитами. С одной стороны, в них лучше контакт между магнитострикционным и пьезоэлектрическим слоями, чем в многослойных композитах, что приводит к увеличению эффекта. С другой стороны, наличие механической связи между активным МЭ-слоем и пассивной подложкой приводит к тому, что она "зажимает" активный слой, вследствие чего можно ожидать, что величина эффекта в таких структурах будет пренебрежимо малой по сравнению с величиной эффекта в многослойных и объемных композитах [3]. Тем не менее изготовленная на подложке из кремния двухслойная тонкопленочная структура феррит-кобальтовая шпинель-цирконат-титанат свинца (CFO/PZT) обнаружила хорошие МЭ-свойства [2]. В настоящей работе на примере простой модели показано, что при определенных условиях подложка "не зажимает" активный магнитострикционно-пьезоэлектрический слой и величина МЭ-эффекта практически не зависит от толщины подложки.

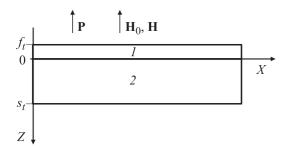
### 2. Модель и основные уравнения

В качестве модели рассмотрим структуру, представляющую собой МЭ-пленку толщиной  $^ft$ , выращенную на проводящей подложке толщиной  $^st$  (см. рисунок). Активная МЭ-пленка состоит из двух или более механически связанных магнитострикционных и пьезоэлектри-

ческих слоев (связь 2-2) либо из зерен или наностолбиков из магнитострикционного материала, внедренных в пьезоэлектрическую матрицу (связь 0-3 или 1-3) [3]. Поскольку характерные размеры структурных единиц МЭ-пленки (толщина слоев, радиус зерна или диаметр столбика) много меньше размеров образца и характерных масштабов изменения внешних воздействий, с макроскопической точки зрения такую МЭ-пленку можно рассматривать как однородную среду, свойства которой описываются некоторыми эффективными параметрами. Методика расчета эффективных параметров среды, предложенная первоначально в [4,5], получила дальнейшее развитие в работах [6,7].

В качестве примера рассмотрим образец в форме прямоугольной пластинки шириной W и длиной L. Выберем систему координат таким образом, чтобы ее начало совпадало с границей раздела слоев, а ось Z направим вертикально вниз, перпендикулярно границе раздела (см. рисунок). Пусть МЭ-пленка поляризована перпендикулярно плоскости контактов (ось Z). В дальнейшем будем считать, что толщина пленки f много меньше толщины подложки f.

Рассмотрим продольный МЭ-эффект. В этом случае магнитные поля (постоянное  $\mathbf{H}_0$  и переменное  $\mathbf{H}$  с частотой  $\boldsymbol{\omega}$ ) совпадают по направлению с вектором поляризации  $\mathbf{P}$ . Ограничимся рассмотрением планарных колебаний, распространяющихся вдоль пластинки (ось X). Переменное магнитное поле возбуждает в магнитострикционной фазе пленки продольные колебания среды, которые посредством механического контакта между фазами передаются в пьезоэлектрик, где и возникает электрическое поле. При этом вследствие механической связи на границе раздела пленка—подложка колебания МЭ-пленки посредством сдвиговых напряжений переда-



Схематическое изображение структуры. 1 — магнитоэлектрическая пленка толщиной  $^ft$ , 2 — подложка толщиной  $^st$ .

ются в подложку, и в ней также возникают механические колебания. Подложка в данном случае играет роль пассивной среды, на которой находится активный МЭ-слой. Поскольку имеется резкая граница между МЭ-пленкой и пассивной подложкой, амплитуда колебаний будет неоднородной перпендикулярно границе раздела.

В соответствии с этим обобщенный закон Гука, связывающий тензоры деформаций  $S_{ij}$  с тензорами напряжений  $T_{ij}$  и напряжениями, вызванными электрическим и магнитным полями, запишется в виде

$${}^{f}S_{xx} = \frac{1}{{}^{f}E} {}^{f}T_{xx} + d_{xx,z}E_{z} + q_{xx,z}H_{z}, \tag{1}$$

$${}^fS_{xz} = \frac{1}{{}^fG} {}^fT_{xz}, \tag{2}$$

$${}^{s}S_{xx} = \frac{1}{{}^{s}F} {}^{s}T_{xx}, \qquad (3)$$

$${}^sS_{xz} = \frac{1}{{}^sG} {}^sT_{xz}. \tag{4}$$

Здесь  ${}^fS_{ij}$ ,  ${}^fT_{ij}$ ,  ${}^sS_{ij}$ ,  ${}^sT_{ij}$  — компоненты тензора деформаций и напряжений пленки и подложки соответственно,  ${}^fE$ ,  ${}^sG$ ,  ${}^sE$ ,  ${}^sG$  — модуль Юнга и модуль сдвига пленки и подложки,  $d_{xx,z}$ ,  $q_{qq,z}$  — компоненты пьезо-электрического и пьезомагнитного модулей,  $E_z$ ,  $H_z$  — напряженности электрического и магнитного полей. Для индукции электрического поля, возникающего в пленке, имеет место уравнение

$$D_z = \varepsilon_{zz} E_z + d_{xx,z} {}^f T_{xx}, \qquad (5)$$

где  $\varepsilon_{zz}$  — компонента тензора диэлектрической проницаемости пленки.

Поскольку имеется выделенное направление — ось Z, совпадающее с направлением поляризации и направлением постоянного магнитного поля, а также неоднородность вдоль оси Z, связанная с границей раздела пленка—подложка, в первом приближении можно считать, что вдоль оси Y смещения будут однородными и отличными от нуля компонентами будут только компоненты напряжений  ${}^{\alpha}T_{xx}$  и  ${}^{\alpha}T_{xz}$ . В соответствии с этим уравнение движения среды для МЭ-пленки и подложки

имеет вил

$${}^{\alpha}\rho \frac{\partial^{2\alpha}u_{x}}{\partial t^{2}} = \frac{\partial^{\alpha}T_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial^{\alpha}T_{xz}}{\partial z},\tag{6}$$

где индекс  $\alpha$  равен соответственно f для пленки и s для подложки. Совместное решение уравнений (1)-(6) позволяет определить МЭ-свойства структуры.

## 3. Магнитоэлектрический коэффициент по напряжению

Важнейшей характеристикой МЭ-эффекта является магнитоэлектрический коэффициент по напряжению  $\alpha_E$ , который определяется как  $\alpha_E = \langle E \rangle/H$ . Здесь  $\langle E \rangle$  — среднее значение напряженности электрического поля, H — напряженность переменного магнитного поля. Для его нахождения используют уравнение (5) с учетом реализуемого в эксперименте условия разомкнутой цепи. В (5) входит тензор напряжений  ${}^fT_{xx}$ , выражение для которого можно получить из совместного решения системы уравнений (1)-(4) и уравнения (6). Поскольку имеется неоднородность вдоль оси Z, решение уравнения (6) для вектора смещения среды  ${}^au_x$  представим в виде плоских волн, амплитуда которых изменяется по толщине образца,

$${}^{\alpha}u_{x} = {}^{\alpha}g(z)({}^{\alpha}A\cos(\omega t - kx) + {}^{\alpha}B\sin(\omega t - kx)), \quad (7)$$

где  ${}^{\alpha}A$  и  ${}^{\alpha}B$  — постоянные интегрирования. Подстановка выражения (7) в уравнение движения (6) приводит к следующему уравнению для функции  ${}^{\alpha}g(z)$ :

$${}^{\alpha}G\frac{\partial^{2\alpha}g(z)}{\partial z^{2}} + ({}^{\alpha}\rho\omega^{2} - {}^{\alpha}Ek^{2})^{\alpha}g(z) = 0.$$
 (8)

После преобразований уравнения для функций, определяющих изменение амплитуды колебаний в пленке  ${}^fg(z)$  и подложке  ${}^sg(z)$ , примут вид

$$\frac{\partial^{2} f g(z)}{\partial z^{2}} + 2(1+\nu) \left[ \frac{\omega^{2}}{f V_{L}^{2}} - k^{2} \right] f g(z) = 0, \quad (9)$$

$$\frac{\partial^{2s}g(z)}{\partial z^{2}} + 2(1+\nu) \left[ \frac{\omega^{2}}{sV_{L}^{2}} - k^{2} \right]^{s}g(z) = 0, \quad (10)$$

где  $\frac{1}{fV_L^2} = \frac{f\rho}{fE}$ ,  $\frac{1}{sV_L^2} = \frac{s\rho}{sE}$  — скорости продольных волн в пленке и подложке соответственно,  $v = -\frac{s_{12}}{s_{11}}$  — коэффициент Пуассона, который для обеих сред предполагается одинаковым. Вид функций  $^fg(z)$  и  $^sg(z)$  (экспоненциальные или тригонометрические) зависит от знака члена, стоящего в квадратных скобках в уравнениях (9) и (10). При одинаковых значениях  $\omega$  и k один из коэффициентов, стоящих в квадратных скобках, будет меньше нуля, а другой — больше нуля. Для определенности выберем структуру, представляющую собой МЭ-пленку из феррит-никелевой шпинели и цирконата-титаната свинца, выращенную на подложке из титаната стронция. В этом случае скорость распространения упругих волн

1114 Д.А. Филиппов

в подложке будет больше, чем в МЭ-пленке. В соответствии с этим при одинаковых значениях  $\omega$  и k коэффициент, стоящий в квадратных скобках в (9), будет больше нуля, а в (10) — меньше нуля, и решения уравнений запишутся в виде

$$fg(z) = C_1 \cos(f \chi z) + C_2 \sin(f \chi z),$$
 (11)

$${}^{s}g(z) = C_3 \exp(-{}^{s}\chi z), \tag{12}$$

где введены следующие обозначения:  ${}^f\chi^2=2(1+\nu)$   $imes \left(\frac{\omega^2}{{}^fV_L^2}-k^2\right)$ ,  ${}^s\chi^2=-2(1+\nu)\left(\frac{\omega^2}{{}^sV_L^2}-k^2\right)$ . Для определения постоянных интегрирования вос-

Для определения постоянных интегрирования воспользуемся граничными условиями, а именно на свободной поверхности, т.е. в точке  $z=-^ft$ , нормальная составляющая тензора напряжений равна нулю; на границе раздела в точке z=0 смещения первой и второй сред одинаковы и одинаковы сдвиговые напряжения. Это дает следующую систему уравнений:

$$C_1 \sin(f \chi^f t) + C_2 \cos(f \chi^f t) = 0,$$
 (13)

$$C_1 = C_3, \tag{14}$$

$${}^fG^f\chi C_2 = -{}^sG^s\chi C_3. \tag{15}$$

Условия совместимости системы приводят к уравнению

$$tg^f \kappa = {}^s G^s \chi / {}^f G^f \chi, \tag{16}$$

где введен безразмерный параметр  $f \kappa = f \chi^f t$ .

Уравнение (16) в неявном виде определяет дисперсионное соотношение при распространении упругих волн в структуре МЭ-пленка—подложка. Воспользуемся тем, что пленка тонкая, поэтому параметр  ${}^f\kappa \ll 1$ ; в первом приближении можно считать, что  $\lg^f\kappa \approx {}^f\kappa$ , и уравнение (16) сводится к виду

$${}^f\chi^f\kappa = ({}^sG/{}^fG)^s\chi. \tag{17}$$

Используя малость параметра  ${}^f \kappa$  и решая уравнение (17) методом последовательных приближений, для параметра  ${}^s \chi$  получим следующее выражение:

$${}^{s}\chi = 2(1+\nu)({}^{f}G/{}^{s}G)(({}^{s}V_{L}/{}^{f}V_{L})^{2} - 1)k^{f}\kappa. \tag{18}$$

Отсюда следует дисперсионное соотношение

$$\omega = {}^{s}V_{L}k[1 - (1 + \nu)({}^{f}G/{}^{s}G)^{2}(({}^{s}V_{L}/{}^{f}V_{L})^{2} - 1)^{2}{}^{f}\kappa^{2}].$$
(19)

Как видно из (19), скорость распространения упругих волн в структуре МЭ-пленка—подложка зависит от волнового вектора и ее значение больше, чем скорость распространения волн в пленке, но несколько меньше скорости распространения продольных волн в подложке. Глубина проникновения волн определяется параметром  ${}^s\chi$ . Параметр  ${}^f\kappa$ , входящий в выражение (18) для  ${}^s\chi$ , вследствие малости толщины пленки много меньше единицы; следовательно, распространение волн происходит в узком приповерхностном слое, глубина которого уменьшается с увеличением частоты колебаний.

МЭ-коэффициент  $\alpha_E$  определим обычным способом [8], используя условие разомкнутой цепи и условие механического равновесия, которое приводит к следующим граничным условиям на свободных поверхностях пластинки:

$$\int_{-t}^{0} {}^{f}T_{xx}(\pm L/2,z)dz + \int_{0}^{s_{t}} {}^{s}T_{xx}(\pm L/2,z)dz = 0. \quad (20)$$

Используя уравнения (6), (11), (12), с учетом граничных условий (13), (14) и (20) для смещений МЭ-пленки получим выражение

$${}^{a}u_{x}(x,z) = B_{1}\left(\cos({}^{f}\chi z) - \operatorname{tg}({}^{f}\kappa)\sin({}^{f}\chi z)\right)\sin(kx), \quad (21)$$

где

$$B_1 = \frac{d_{xx,z}E_z + q_{xx,z}H_z}{k\cos(\kappa/2)[\lg(f\kappa)/f\chi + (1 - \exp(-s\kappa)/s\chi)]},$$
$$\kappa = kL, \quad {}^s\kappa = {}^s\chi^s t$$

безразмерные параметры.

Электрический ток найдем, используя соотношение

$$I = \int_{0}^{W} dy \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\partial D_z}{\partial t} dx.$$
 (22)

Выражая компоненты тензора напряжений через компоненты тензора деформаций из уравнения (2) и подставляя их в уравнение (5), получим выражение для  $D_z$ . Далее, подставляя полученное для  $D_z$  выражение в уравнение (22) и используя условие разомкнутой цепи I=0, получим уравнение для напряженности электрического поля  $E_z$ , из которого найдем МЭ-коэффициент по напряжению как  $\alpha_E=E/H$ .

Выполняя указанные преобразования, окончательно для МЭ-коэффициента получим следующее выражение:

$$\alpha_E = \frac{{}^f E d_{xx,z} q_{xx,z}}{\varepsilon_{zz}} \frac{\Delta}{\Delta_{\alpha}}, \tag{23}$$

где

$$\Delta = 1 - \frac{\operatorname{tg}(\kappa/2)}{\kappa/2} \frac{1}{[1 + \gamma(1 - \exp(-s\kappa))]/(s\chi^f t)},$$
  
$$\Delta_a = 1 - K_p 2\Delta, \quad \gamma = E/f E.$$

Здесь  $K_p^2={}^fEd_{xxz}^2/(arepsilon_{zz})$  — квадрат коэффициента электромеханической связи.

#### 4. Заключение

Как следует из выражения (23), частотная зависимость МЭ-коэффициента по напряжению имеет резонансный характер. На так называемой частоте антирезонанса, когда  $\Delta_a=0$ , имеет место пиковое увеличение МЭ-коэффициента. Частота резонанса зависит

от геометрических размеров пластинки и параметров, характеризующих механические свойства МЭ-слоя и подложки. В областях, далеких от резонанса, величина МЭ-коэффициента практически не зависит от частоты и толщины подложки.

Таким образом, для структуры активная МЭ-пленка—пассивная подложка, в том случае, когда скорость распространения упругих волн в подложке больше, чем в пленке, величина МЭ-эффекта практически не зависит от толщины подложки и определяется эффективными параметрами активной МЭ-пленки.

### Список литературы

- H. Zheng, J. Wang, S.E. Lofland, Z. Ma, L. Mohaddes-Ardabili,
   T. Zhao, L. Salamabca-Riba, S.R. Shinde, S.B. Ogale, F. Bai,
   D. Viehland, Y. Jia, D.G. Schlom, M. Wuttig, A. Routburd,
   R. Ramesh. Science 303, 661 (2004).
- [2] J. Zhou, H. He, Z. Shi, C.W. Nan. Appl. Phys. Lett. 88, 013 111 (2006).
- [3] C.-W. Nan, G. Liu, Y. Lin, H. Chen. Phys. Rev. Lett. 94, 197 203 (2005).
- [4] G. Harshe, J.O. Dougherty, R.E. Newnham. Int. J. Appl. Electromagn. Mater. 4, 145 (1993).
- [5] G. Harshe, J.P. Dougherty, R.E. Newnham. Int. J. Appl. Electromagn. Mater 4, 161 (1993).
- [6] М.И. Бичурин, В.М. Петров, Д.А. Филиппов, Г. Сринивасан, В.М. Лалетин. Перспективные материалы 6, 5 (2004).
- [7] I.A. Osaretin, R.G. Rojas. Phys. Rev. B 82, 174415 (2010).
- [8] Д.А. Филиппов, М.И. Бичурин, В.М. Петров, В.М. Лалетин, Н.Н. Поддубная, G. Srinivasan. Письма в ЖТФ **30**, *1*, 15 (2004).